

**KIEFER Frédéric**  
14, rue du moulin à vent  
91590 Cerny.  
Domicile: 01.64.57.72.41.  
Portable : 06.27.13.79.99  
f.kiefer@free.fr

Nationalité Française.  
Né le 16.12.1969 à Blois.  
Marié, deux enfants.



## **DUT MESURES PHYSIQUES**

### **Expériences professionnelles :**

**Café Le Latino – Gérant de la SARL Le Latino depuis le 1.09.2009**  
Exploitation d'un fond de commerce bar, rapido, jeux (FDJ).

**VIC LEAK DETECTION – Vente et service après vente des détecteurs de fuites de marque VIC et Veeco.**

Technicien SAV du 04.02.2008 au 17.06.2009:

- Maintenance des détecteurs de fuites.
- Devis et suivi des contrats de maintenance.
- Etalonnage de fuites étalons hélium

**40-30 – Société de maintenance industrielle, spécialisée dans le vide. Service vide intervention.**

Agent de maîtrise du 19.01.2004 au 04.02. 2008 :

- Maintenance de pompes primaires et secondaires.
- Maintenance de vannes.
- Intervention sur site client pour expertise et diagnostic de panne.
- Suivi contrats clients.
- Détection de fuite à l'Hélium.
- Entretien et étalonnage de jauges primaires et secondaires.

**A-A Optoélectronique – Fabrication de modulateurs, filtres acousto – optique.**

Technicien process du 03.12.2001 au 19.01.2004:

- Traitement anti-reflet des cristaux par évaporation et pulvérisation.

### **PICOGIGA – Fabrication de transistors P-HEMT et HBT.**

Ingénieur process du 11.12.2000 au 20.11.2001 :

- ❑ Production sur différents bâtis d'épitaxie MBE sur Riber 49, Riber 6000, et V100.

### **TEKELEC TEMEX - Fabrication de diodes hyperfréquences – AFAQ ISO 9001&14001.**

Responsable Technique d'un service d'épitaxie composé de quatre personnes du 01.09.1996 au 11.12.2000 :

- ❑ Ordonnancement/lancement.
- ❑ Gestion des stocks et des approvisionnements.
- ❑ Gestion des commandes et suivi des livraisons.
- ❑ Suivi et audits des sous traitants.
- ❑ Prise en charge de stagiaire DUT Mesures Physiques.
- ❑ Service d'astreinte.

Technicien Process. Maîtrise des procédés d'épitaxie et de diffusion du 01.07.1993 au 01.09.1996 :

- ❑ Dépôts LPCVD/PECVD de silice / nitrure.
- ❑ Dépôts épitaxiés en MOCVD.
- ❑ Maintenance préventive et curative des bâtis.
- ❑ Caractérisation Spreading Resistance, C(V), Schottky Mercure.
- ❑ Changement des bouteilles de gaz.

### **Formation :**

2007:                   Renouvellement CEFRI  
2004 :                   Formation initiale CEFRI.  
1993 – 1999 :         Stage incendie, secouriste du travail, gaz spéciaux.  
04.08.92 – 27.05.93 : Service militaire en tant que chef d'équipe au centre de sélection n°10 de Blois.  
01.04.92 – 30.06.92 : Stage de fin d'études dans le service de Chimie Moléculaire du CEA de Saclay.  
1992 :                   Obtention du DUT de Mesures Physiques.  
                          I.U.T. d'Orsay (Université de Paris XI).  
1989 :                   Obtention du Baccalauréat Série D (mention AB).  
                          Anglais : lu, écrit et parlé.  
                          Informatique : Word, Excel, Powerpoint.

### **Centres d'intérêt :**

VTT, informatique, bricolage, guitare.